



## 半導體製程設備安全評估與節能的有效做法

### ◎議程說明：

SEMI 國際半導體產業協會、TSIA 台灣半導體協會與 SGS 共同合作，針對 SEMI 製程設備安全評估實務與做法為提升高科技產業製程安全，並為加速推廣 Fab 環境健康安全 EHS 觀念，降低機台潛在風險、建置工作安全環境並減少機台對環境及人員的衝擊。

本研討會內容主要為說明 SEMI S2/S8/S10/S14/S17/S28 的範圍、架構，以及半導體製造設備的風險量化與功能安全，展現以確效查核的方式有效執行安全評估。

本次議題也針對 SEMI S23 能源使用與耗能評估提供說明。

另外，智慧製造的議題持續發酵，AI 自動化機台已導入半導體產業 SEMI S17/S28，例如：機器手臂 (ROBOT) 與無人搬運車 (AGV) 與 Auto Load port 的使用為未來的趨勢。此類自動化裝置於無塵室內的使用越見頻繁，本次議題亦加入無塵室內使用儀器與設備之發塵量分析相關測試議題。

歡迎會員及相關業者共同參與，機會難得，敬請把握！

SEMI will collaborate with SGS, dedicated to the safety process of high-tech industry production, assessment and practice of SEMI production equipment. In order to expedite the concept facilitation of Fab Environmental Health & Safety EHS, hence, reducing the potential risk of in-line equipment, building a safe working environment and minimizing the impact (of inline equipment) to environment and production personnel.

The seminar intends to illustrate the scope, structure, quantitative risk analysis and functional safety of SEMI S2/S8/S10/S14/S17/S28, and demonstrate the effective implementation for safety assessment. We will also focus on the energy use and consumption for SEMI S23.

In addition, as Smart Manufacturing has been heatedly discussed, AI automated machine has already been implemented into the industry SEMI S17/S28, e.g. the use of Robot arms, AGV and Auto Load ports are undoubtedly the future trends of this industry. The usage of this automated device within the production line has been commonly increased. The relevant issues for clean room effect analysis and instrument imitate dynamic particle analysis are also included in this seminar.

Members and associated dealers are welcomed! Limited opportunities! Come sign up now!

◎主辦單位：	SEMI 國際半導體產業協會 
◎協辦單位：	SGS Taiwan  TSIA 台灣半導體協會 
◎舉辦時間：	2018年6月29日 13:00-17:00
◎舉辦地點：	台元三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)
◎受邀對象：	勞安衛(廠務)管理人員、半導體製程設備設計人員、部門主管等。
◎參加人數：	60人 (額滿為止，依完成報名先後順序錄取；主辦單位保有最終審核與決定權)
◎報名資訊：	Tiffany Huang 黃懷萱/ E-mail: <a href="mailto:thuang@semi.org/">thuang@semi.org/</a> Tel: +886-3-560-1777 ext. 510 Denise Cheng 鄭小姐 <a href="mailto:denise.cheng@sgs.com">Email 至 denise.cheng@sgs.com</a> Tel:+886 2299 3279 ext.5111 傳真：(02)2299-3440 名額有限，額滿為止！
◎報名費用：	無，免費參加 報名成功後，會以 E-mail 方式寄發報名成功通知； 主辦單位保有最終審核與決定權
◎活動聯絡人：	SEMI：Tiffany Huang 黃小姐 E-mail: <a href="mailto:thuang@semi.org">thuang@semi.org</a> Tel: +886-3-560-1777 ext. 510 SGS：Denise Cheng 鄭小姐 E-mail: <a href="mailto:denise.cheng@sgs.com">denise.cheng@sgs.com</a> Tel: +886-2-2299-3279 ext. 5111
◎預定議程表：	請見下表 (議程時間內容可能受講師影響有所調整，實際依上課通知為主)
◎為了尊重授課公司著作權與客戶機密資料，現場請勿拍照、錄音或攝影	

## ◎議程表

時間	議程	演講者
13:00~13:20	報到	-
13:20~13:40	主持人 致詞	張德安 SEMI 資深執行顧問 (Dr. Dean Chang, SEMI, Executive Senior Consultant)
13:40~14:40	SEMI S2/S8/S10/S14/S17/S28 Compliance Evaluation and related the assessing standards	呂宗穎 經理 (SGS CRS-Inspection Division)
14:40~14:50	休息時間	
14:50~15:40	Spilling Particles of Operational Outgassing on the Overall Cleanliness 動態潔淨度測試	簡士政 博士 (Dr. Sam S.C. Chien SGS CRS-EE-RSTS- sc/ic)
15:40~16:30	SEMI S23 Evaluation - Energy saving on semiconductor equipment	林建興 經理 (SGS Safety Lab.)
16:30~16:40	Q & A	

※主辦單位保有變更一切議程之權力※

### ◎ 特別申明

本協會依據個人資料保護法第 8 條規定告知以下事項，請務必詳細閱讀以保護您個人資料的隱私與 權益。

本協會為維護您及 貴公司之權益，因本研習會將透過網路、電子郵件、書面、電話或傳真等合法方式，向您要求可供辨識之個人資料，以利進行資料傳遞、處理與利用行為。上述個人資料將視計畫業務或活動性質請您提供必要之正確個人資料，於特定目的範圍內蒐集、處理及利用您的個人資料；本中心亦遵守相關之流程及內部作業規範，非經您書面同意，不會將個人資料用於其他用途。但有法律依據或合約義務者，不在此限。若 貴公司拒絕提供相關個人資料，本中心將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供本中心相關服務及諮詢。未來若您覺得不再需要本中心提供相關服務，或對使用情形有問題時，您可以透過電子郵件、電話、傳真或書面等方式來主張請求查詢、閱覽、給複製本、補充、更正、刪除或停止蒐集、處理、利用之權利。當您提繳報名資訊之同時，即視為已知悉並完全同意本中心之個資法規範或隱私權政策的任何內容。

## ◎ 交通資訊

地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓

請點選以下連結參考交通資訊：

<http://www.tyht-service.com.tw/service/Transportation.htm>

位置圖：





## SEMI 半導體製程設備安全評估與節能的有效做法 議程報名表

- ★參加對象：勞安衛(廠務)管理人員、半導體製程設備設計人員、部門主管等
- ★費用：免費參加，名額有限，額滿為止。  
(主辦單位保有最終審核與決定權)
- ★日期：2018年6月29日下午13:00-17:00
- ★議程地點：台元三期多功能會議室
- ★地址：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
- ★報名方式：Tiffany Huang 黃懷萱/ Email 至 [thuang@semi.org](mailto:thuang@semi.org)  
Tel: +886-3-560-1777 ext. 510  
Denise Cheng 鄭小姐 Email 至 [denise.cheng@sgs.com](mailto:denise.cheng@sgs.com)  
Tel:+886 2299 3279 ext.5111 傳真：(02)2299-3440  
名額有限，額滿為止！

★注意事項：

- 1.參加人員請攜帶名片一張。
- 2.主辦單位保有最終審核與決定權。  
(報名成功會以 E-mail 方式寄發報名成功通知，請務必填寫 E-mail。)
- 3.報名表格請以正楷填寫，請勿草寫避免資料登記錯誤。

公司名稱					
連絡人			電話：( )	分機	
部門			職稱		
連絡人 E-Mail					
參加人員		分機		部門	
E-Mail				職稱	
參加人員		分機		部門	
E-Mail				職稱	

如有任何報名問題，請洽

SEMI：Tiffany Huang 黃懷萱/ E-mail: [thuang@semi.org](mailto:thuang@semi.org)/ Tel: +886-3-560-1777 ext. 510

SGS TW：Denise Cheng 鄭小姐/E-mail: [denise.cheng@sgs.com](mailto:denise.cheng@sgs.com) / Tel: +886-2-2299-3279 ext. 5111